

(11) Publication number:

58140175 A

# Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **57023341** 

(51) Intl. Cl.: H01S 3/096

(22) Application date: 16.02.82

(30) Priority:

19.08.83 (43) Date of application publication:

(84) Designated contracting states:

**TOSHIBA ENG CO LTD** (71) Applicant: TOSHIBA CORP

(72) Inventor: KONISHI KUNIYOSHI JINBO YASUSHI SHIDA KOJI

(74) Representative:

# DETECTING METHOD FOR SEMICONDUCTOR LASER 54) ABNORMALITY DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To simply determine and as the condition for giving a decision specified in the specification for the set the reference voltage, to be used method wherein a bias current and (LD), based on the characteristics for a semiconductor baser diode semiconductor laser diode by a

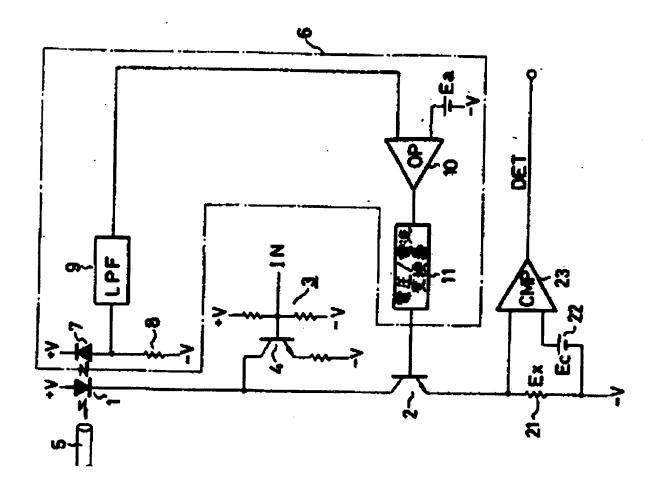
1/13/2004

the reference voltage to be determined as abnormal are compared with each other.

with which the output voltage EX and CONSTITUTION: The photo output converted, 1 to voltage and a CMP23, which the LD1 will be determined as bias current to be supplied to the LD the reference voltage 22 that was set voltage 22 and the CMP23, in other detection of abnormality of the LD1 is conducted based on the results of based on the result wherether or not stabilized circuit 6, with which the so as to stabilize said photo output the actual bias current has become based on the bias current value at abnormality of LD1 is performed said comparison of the reference larger than the bias current to be abnormal, is provided and the will be variably controlled, is provided. The bias current is of the LD1 is detected and a words, the detection of the determined as abnormal.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

1/13/2004



### (19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

## ⑫ 公開特許公報 (A)

昭58—140175

⑤Int. Cl.<sup>3</sup>

H 04 B

②特

識別記号

庁内整理番号

②公開 昭和58年(1983)8月19日

H 01 S 3/096

7377—5 F 6666—5 F 6442—5 K

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

の半導体レーザダイオードの異常検出方式

願 昭57-23341

**20**出 願 昭57(1982) 2 月16日

9/00

70発 明 者 古西邦芳

東京都府中市東芝町1番地東京 芝浦電気株式会社府中工場内

⑩発 明 者 仁保康

東京都港区西新橋1の18の17東

芝エンジニアリング株式会社内

⑩発 明 者 司田浩二

東京都港区西新橋1の18の17東 芝エンジニアリング株式会社内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

⑪出 願 人 東芝エンジニアリング株式会社

東京都港区西新橋1の18の17

個代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 細 膏

1.発明の名称

半導体レーザダイオードの異常検出方式

2.特許請求の範囲

3 条明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は特に光伝送用の発光案子として用い られる半導体レーザダイオードの異常検出方式 に関する。

### 〔発明の技術的背景〕

一般に半導体レーザダイオード(以下、LD と称する)は、情報伝送の超高速化および長距 離化が要求される光伝送における送信部(光送 信回路)の発光業子として用いられることが多 い。周知のようにLDの光出力は温度依存性が あるため安定性に欠ける。そこで安定化回路 (以下、APCと称する)により光出力の安定 化が図られるようになつている。すなわち、 APCはLDの光出力を検出し、この検出結果 に応じて L D に供給されるパイアス電流 I B を 可変餌御するもので、これによりLDの光出力 の安定化が図られる。ところで、LDKは経時 劣化があり、このような場合、温度やバイアス 電流が一定であつても時間の経過とともに L D の光出力が低下する恐れがある。通常APCは このような劣化現象にも動作してパイアス電流

を増加せしめ一定の光出力が得られるように制 倒している。しかし、LDの劣化が進むにつれ て、たとえAPCが上記パイアス電流を増加し ても所定の光出力が得られなくなる。そこで、 送信側において、LDから出力される光信号を 交光業子で受けてその光出力を監視し、LDの 劣化や故障を検出、予知する監視回路が必要で あつた。

第1回はこのような監視機能を備えた従来の 光送信回路におけるLD(半導体レーザタはLD(半導体ので、1LD1にを示す。2はに、LD1にのでは、「Laを供給するペイアス電流のという。3は、上のでは、といるのでは、このでは、この光質を変調し、この光質をは、この光質をは、カーフィックには、この光質をは、カーフィックには、この光質をは、カーフィックには、この光質をは、カーフィックには、カーブルの光質をは、カーブルの光質をは、カーブルの光質をは、カーブルの光質をは、カーブルの光質をは、カーブルの光質をは、カーブルのような。このようなは、カーブルを表している。このようなは、カーブルを表している。このようなは、カーブを表している。このようなは、カーブを表している。このようなは、カーブルを表している。このようなは、カーブルを表している。このようなは、カーブルを表している。このようなは、カーブを表している。このようなは、カーブを表している。このようなは、カーブを表している。このようなは、カーブを表している。このようなは、カーブを表している。このようなは、カーブを表している。このようなは、カードを表している。このようなは、カードのようなは、カードを表している。このようなは、カードを表している。このようなは、カードには、カードを表している。このようなは、カードを表している。このまでは、カードをまでは、カードを表している。このまでは、カードをまでは、カードをまでは、カードをまでは、カードをまでは、カードをまでは、カードをまでは、カードをまでは、カードをまでは、カード

給される。これにより、LDIに供給されるパイアス電流IBが可変され、LDIの光出力が一定となるように割御される。

LPFgの出力電圧は比較器(以下、CMP と称する)12の一方の入力端子にも供給され る。СMP12の他方の入力増子には参照電圧 Eb が供給されている。この参照電圧 Eb は、 LD1か再命あるいは故障であると判断される 光出力に対応する電圧値である。 CMP12 は LPF9の出力電圧と参照電圧 Eb とを比較し、比 較結果に応じた 2 値倡号を出力する。LD1が 正常な通常狀態では、LD1の光出力は APC6 の制御により上述したように一定に保たれてお り、LPF9の出力電圧>参照電圧 Eb である。 一方、LD1が異常となり、LD1の光出力が 低下し、APC6の制御によりパイアス電流IB が増加されてもLDIの光出力が所定出力に保 たれない場合、LPF9の出力電圧≤参照電圧 Pub となる。そして、この状態における比較器 13の出力によってLDIの異常が検出される。 るに送出される。 6 は前述したAPC(安定化 回路)であり、フォートダイオード(以下、 PDと称する)7、電流/電圧変換器としての 抵抗 8、ローペスフイルタ(以下、LPFと称 する)9、オペアンプ(以下、OPと称する) 10、および電圧/電流変換器 1 1 を有してい る。

LDIから出力される光信号はPD7で検出されて気信号に変換された後、抵抗8で電圧に変換された後、抵抗8で電圧は LPF9でその高周波分が除去されてOPIのの一方の入力端子にはLDIの所定の光出力に対応する基準電圧Eaが供給されている。しかして OPIのはLPF9の出力電圧と(所定の光 カを得るための)基準電圧Eaとを比較し、その電圧差に応じた出力電圧を発生する。

OP10からの出力電圧は電圧/電流変換器 11によつて電流に変換され、パイアス制御用 ペース電流としてトランジスタ 2 のペースに供

### (背景技術の問題点)

このように従来のLD駆動回路では、LD1 の光出力に対応するLPF9の出力を監視し、 このLPFタの出力と参照電圧Ebとの大小比較 により異常検出を行なうようになつていた。こ の場合、LDIの光出力を検出するためには煎 述したようにLDIにPD1を結合させ、PD7 によって光/電気電換を行なわせる必要があっ た。しかし、LDIとPD1の結合には各回路 毎にはらつきが生じるため、たとえ LD 1 の光 出力が一定であつてもPDクにおける光検出出 力は各回路毎に異なるのが一般的であつた。こ のため、従来のLD駆動回路では、各回路毎に 光測定器等を用いてLD1の光出力とPD1に おける光検出出力との関係を把握し、異常判定 条件としての参照電圧を調整しなければならず、 実用性に乏しい欠点があつた。

### (発明の目的)

本発明は上記事情に鑑みてなされたものでそ の目的は、LD(半導体レーザダイオード)の 異常判定条件としての参照電圧(基準電圧)を、 LDの仕様上の特性に基づいて極めて簡単に決 定し設定でき、もつてLDの異常検出が効率よ く行なえる実用性に富んだ半導体レーザダイオ ードの異常検出方式を提供することにある。 (発明の概要)

LD(半導体レーザダイオート)の光出力を 検出しいこの光出力に 供給されるパイアを可能をして、 供給されるパイアを健定を可能をして、 は安定には、 との光のでは、 とのとして、 をでは、 をでいる。 のでは、 をでは、 のでは、 のでいる。 のでは、 ので

(発明の実施例)

ところで、LDIの素子劣化に伴つてLDIの光出力が減少した際に、上述のように APC6によつてパイアス電流 IB が増加され、所定の光出力が安定して得られるように制御されるが、パイアス電流 IB を充分に増やしても所定の光出力が得られない場合がある。このような狀態に

以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。なお、第1図と同一部分には同一符号を付して詳細な説明を省略する。第2図のLD 配動図路において、21はトランスタ2ののように接続されるパイアス電流製限抵抗である。22は参照電圧(基準電圧) Bcを発生する 参照電圧発生器、23はCMP(比較器)である。CMP33は抵抗21の両端電圧 Bxと参照電圧発生器22で発生される参照電圧 Bcとの大小を比較し、例えば Bx ≥ Bc の場合に論理『1』の異常検出信号 DET を出力するようになつている。

次に本発明の一実施例の動作を説明する。一般にLDが発振を始める電流はスレッショルド電流Ith と称されている。通常LD駆動回路ではこのスレッショルド電流Ith をパイアス電流In としてLDに定常的に供給するようになつている。したがつて、第2図の構成においてLD』の電流一先出力特性に変動が無い状態では、LD』の光出力は上記ストッショルド電流Ith

そこで本実施例では、LD1 K供給されるパイアス電流  $I_B$  が初期パイアス電流  $I_{B_0}$  の 1.5 倍化なつたときにLD1 が異常と判定されるパイアス電流  $I_B$  と初期パイアス電流  $I_{B_0}$  の 1.5 倍値とを比較するために、LD1 に供給されるパイアス電流  $I_B$  と初期パイアス電流  $I_B$  に代えて抵抗 21 の両端電圧  $E_X$  を用い、 $E_X$  と  $E_C$  を用い、 $E_X$  と  $E_C$  を比較するようにしている。これは、抵抗 21 の  $E_X$  がパイアス電流  $E_X$  が  $E_X$  を  $E_X$  が  $E_X$  に  $E_X$  が  $E_X$  を  $E_X$  が  $E_X$  に  $E_X$  を  $E_X$  が  $E_X$  に  $E_X$  が  $E_X$  を  $E_X$  が  $E_X$  に  $E_X$  を  $E_X$  が  $E_X$  に  $E_X$  に  $E_X$  が  $E_X$  に  $E_X$  が  $E_X$  に  $E_X$  に E

れた場合の抵抗 2 1 の両端電圧 Ex。の 1.5 倍値 を採用している。

CMP23は抵抗21の両端電圧Ex と参照 塩圧発生器 2 2 で発生される上紀参照電圧 Ec との大小を比較する。通常 ExくEc であるため CMP23から異常検出信号DETが出力され ることはない。これに対し、LD1の菓子劣化 などによりしD1の光出力が低下し、この光出 力を所定レベルに保つようにAPC6の制御に よつてパイアス電流IBが増加されると、抵抗 21の両強電圧 Ex が大きくなつてくる。そして、 このパイアス電流IBが前記初期パイアス電流 IB。の 1.5 倍値に一致するようになると、抵抗 2.1の両端電圧Ex はあらかじめ設定されてい る参照電圧 Bc に一致し、これにより CMP 23 は有効な異常検出信号DETを出力する。この 異常検出信号DETによってLD1の異常、す なわちしり1の寿命または故障などが判断され る。この場合、異常検出信号DETを警報器の 戯動信号としたり、更には他のLDへの切換え

を未然に防止できる。これに対し、従来の方式では、パイアス電流 IBを増加することによつて L D の光出力が一定に保たれる状態では異常検 出は行なわれないため、上述した L D に対する 保護機能を発揮することは困難である。

なお、前記実施例ではパイアス電流 IB が初 別パイアス電流 IB。の 1.5 倍以上となることによりしりの異常を判定する場合について説明したが、これに限定されるものではない。また変数のでは、パイアス電流 IBの電流/電圧変される(パイアス電流制限) 抵抗 2 1 を用いたが、トランジスタ 2 。4 の台について説明したが、トランジスタ 2 。4 のコレクタ間に抵抗を挿入し、この抵抗の両端電圧と参照電圧とを比較するようにしてもよい。(発明の効果)

以上詳述したように本発明のレーザダイオードの異常検出方式によれば、半導体レーザダイオードの異常判定条件としての参照電圧(基準 電圧)の数定が極めて簡単に行なえるので、実 を行なう切換回路に対する切換制御信号とする ことは可能である。

本実施例で適用される参照電圧 Ec は、上述したように初期パイアス電流 IBo により発生する抵抗 2 1 の両端電圧を 1.5 倍した値である。一般にこの初期パイアス電流 IBo として、しりの仕様上の特性で示されているスレンショルド電流 Ith が採用されており、このスレンショルド電流 Ith 、抵抗 2 1 の抵抗値 R に基づいて、従来のように調整等を行なうことなく参照電圧 Ec を決定することができる。この場合、トランシスタ 2 のペース接地電流増幅率を α とすると

 $B_c = 1.5 \times (\alpha \times I_{th} \times R)$   $\geq \pi \delta$ .

また、本実施例によれば、APCの故障により、LDIに供給されるパイアス電流 IB が急増した場合などにも、その旨をCMP 2 3 から出力される異常検出信号DBTによつて検知できるので、これに対処することによりパイアス電流 IB の急増のためにLD1が破壊されること

用性に富んだ半導体レーザダイオードの異常検 出が効率よく行なえる。

### 4.図面の簡単な説明

第1図は従来例を示す回路構成図、第2図は 本発明の一実施例を示す回路構成図である。

1 … 半導体レーザダイオード(LD)、2 … トランジスタ(パイアス電流供給回路)、6 … 安定化回路(APC)、7 … フォトダイオード (PD)、12,23 … 比較器(СMP)、 21 … パイアス電流制限抵抗(電流/電圧変換器)、22 … 参照電圧発生器。

出圖人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

第 2 図

